الخصائص الكهربائية لرقائق نيتريد السيليسيوم اللامتبلور (a-SiN) بطريقة الرش المهبطى: تأثير الاستطاعة RF.

30/12/2000 - 17/07/1999

ملخص

ع. عطاف

جامعة محمد خيضر قسم الفيزياء، ص.ب. 145 ق.ر بسكرة (07000)

م.ص. عيدة

وحدة البحث فيزياء المواد و تطبيقاتها جامعة منتوري قسنطينة (25000)

م.ل. بن خذير

المركز الجامعي العربي النبسي معهد العلوم الدقيقة، تبسة (12000) تستعمل رقائق نيتريد السيليسيوم اللامتبلور (a-SiN) المحضرة تحت درجة حرارة منخفضة بكثرة في ميدان الإلكترونيات الدقيقة. و لملاحظة تأثير الاستطاعة RF على الخصائص الكهربائية لهذه الرقائق، تم ترسيب مجموعة منها تتراوح استطاعة توضعها بين 150 واط و 400 واط. تمت دراسة تغيرات التيار و السعة بدلالة الجهد و ذلك باستخدام تركيبة: (MIS)، حيث كان

تمت دراسة تغيرات التيار و السعة بدلالة الجهد و ذلك باستخدام تركيبة: (MIS)، حيث كان للاستطاعة RF تأثير واضح على هذه الخصائص، إذ بزيادتها تغير نوع النقل من الأومي إلى البول-فرنكل، أما المقاومية (ρ) فقد أبدت تزايدا مع زيادة الاستطاعة، بينما تناقص مجال الانهيار الكهربائي وثابت العازلية الديناميكي (٤٥) مع زيادتها.

دراسة السعة الكهربائية C(v) بينت أن الرقائق تحتوي على حوامل شحن في الحجم و في منطقة التداخل و تزايدت بزيادة الاستطاعة RF، بينما أبدى ثابت العازلية الساكن (ϵ_s) ارتفاعا كبيرا عند الإستطاعات الضعيفة ثم حدث له سقوط سريع، بعدها بدأ في التزايد بزيادة الاستطاعة.

الكلمات المفتاحية: نيتريد السيليسيوم، الرش المهبطي، الشرّائح الرقيقة، الخصائص الكهر بائية.

Abstract

Recently great interest has been paid to amorphous silicon nitride thin films which have found a large range of applications. Certain device processing requires a low temperature of film deposition, thus making sputtering a potentially useful fabrication technique. In order to investigate the influence of the radio frequency (RF) power on the electrical properties of amorphous silicon nitride, films were deposited using powers between 150 and 400 W.

The electrical measurements suggest that the increase in the RF power induces the establishment of the Pool-Frenkel conduction mechanism. An increase in the resistivity and a decrease in the breakdown field of the film.

<u>Key words</u>: silicon nitride, sputtering, thin films, electrical properties.

Résumé

Ces dernières années, les couches minces de nitrures de silicium amorphe trouvent une grande importance surtout dans le domaine de l'électronique. Des couches minces de a-SiN ont été déposées par pulvérisation cathodique sous des basses températures et en utilisant des puissances radio (RF) comprises entre 150 et 400 W afin d'étudier l'influence de la puissance sur les propriétés électriques des couches

Les mesures électriques ont montré que l'augmentation de la puissance RF conduit au mécanisme de conduction de type Pool-Frenckel, à une augmentation de la résistivité électrique et à une diminution du champ de claquage. L'évolution de la capacité C(v) a montré l'existence de porteurs de charges dans le volume ainsi que dans l'interface.

<u>Mots clés</u>: nitrure de silicium, pulvérisation, couches minces, propriétés électriques.

A. ATTAF

Département de Physique Université Mohamed Kheider BP145RP, 07000 Biskra, Algérie

M.S. AIDA

Département de Physique Faculté des Sciences Université Mentouri 25000 Constantine, Algérie

M.L. BENKHEDIR

Institut des Sciences Exactes Centre Universitaire de Tebessa 12000 Tebessa, Algérie

ركزت الأعمال في مجال الإلكترونيات الدقيقة خلال السنوات الأخيرة على رقائق نيتريد السيليسيوم اللامتبلور (a-SiN) و ذلك لما يمتلكه من خصائص من جهة كاستقراره الكيميائي و تطبيقاته الواسعة من جهة أخرى و المتمثلة في تغليف المركبات الإلكترونية و كطبقات ضد انعكاسية فوق الخلايا الشمسية [1] و عزل البوابة عن a-Si:H عند ترانزستور تأثير المجال ذي البوابة المعزولة [2] و أقنعة الانتشار. أضف إلى ذلك ضعف انتشار الأيونات القلوية عند الرقائق التي تخنها أقل من 1µm مقارنة برقائق SiO2 [3].

تتعلق خصائص نيتريد السيليسيوم اللامتبلور بطرق و وسائط التحضير، و لهذا الغرض استخدمت عدة طرق نذكر من بينها:

طريقة النتردة [4] و طريقة التوضع البخاري الكيميائي [5] ، و طريقة طريقة الرش المهبطي بنوعيها (DC و RC) [6-7] ، و طريقة التقريغ المتوهج [8-9] ، و بما أن درجة حرارة تحضير معظم المركبات الإلكترونية تكون منخفضة فإن طريقة الرش المهبطي استخدمت لهذا الغرض مقارنة بطريقة النتردة أو التبخير الكيميائي اللتان تتطلبان درجات حرارة مرتفعة محصورة بين 900 و 1000 درجة مئوية.

عدة بحوث قدمت فيما يخص هذه الرقائق لكنها غير كافية مقارنة بالدراسات التي قدمت عن a-Si $_{1-x}N_x$ خصائص a-Si $_{1-x}N_x$ نتعلق بالنسبة المولية (a-N/Si) التي يتحكم فيها عند طريقة التفريغ الموهج عن طريق نسبة خليط الغازين a-NHa و a-SiHa و a-SiHa و a-SiHa و a-SiHa عند طريقة الرش المهبطي عن طريق تغيرات ضغط الأزوت داخل غرفة التحضير. و نظرا لكثرة الدراسة حول هذا الوسيط، سنقوم بدراسة تأثير وسيط الاستطاعة a-RF على الخصائص الكهربائية لهذه الرقائق.

التفاصيل التجريبية

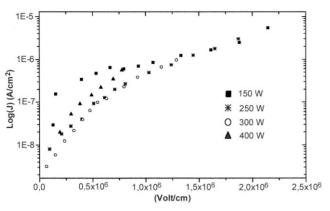
لترسيب رقائق نيتريد السيليسيوم اللامتبلور بطريقة الرش المهبطى استخدمنا جهاز (ALCATEL SM 601) حيث تم خلط غازي الأرجون و الآزوت (Ar/N₂) حتى ضغط كلى مقداره Torr و ضغط جـزئى لغـاز الأزوت يسـاوي Torr 1-07.10، أما الهدف و المتمثل في قرص من السيليسيوم أحادي البلورة و خالى تقريبا من الشوائب ذي قطر 15 cm بينما حامل المساند له قطر يساوي cm 5 ، درجة حرارة هذا الأخير تثبت عند 200 درجة مئوية بينما الاستطاعة RF غيرت بين 150 و 400 واط، و لتفادي التلوث بالأكسجين تم تفريغ غرفة الرش حتى الضغط Torr 6-10. في الدراسة الكهربائية استخدمت مساند من السيليسيوم أحادي البلورة من النوع P ذي مقاومية 3 هذه المساند تعرضت لجميع أنواع التنظيف المعروفة ثم $\Omega {
m cm}$ وضعت فوقها طبقة من نيتريد السيليسيوم اللامتبلور سمكها يتغير بتغير الاستطاعة RF و المدة الزمنية بعدها وضعت التلامسات العلوية و السفلية من الذهب بواسطة جهاز رش ذو جهد مستمر من النوع (EDWARD S 150 B) فتم الحصول على التركيبة MIS .

دراسة تغيرات التيار مع الجهد (I(V) تمت بتوصيل التركيبة MIS بمولد جهد مستقر من النوع (LAMDA LL 905) يتراوح مجال عمله بين (120-0) فولط و علبة حديدية (قفص فرداي) بها فتحات و أسلاك موصلة و محمية بشبكة معدنية و مقياس تيار كهربائي مخزن القيم من نوع (KHEITLY 617)، أما تغيرات السعة مع الجهد (V) فتمت بواسطة دارة تحتوي على مقياس سعة من نوع (HEWELET PACKARD) متصل مباشرة بالتركيبة MIS عن طريق الأسلاك المحمية و العلبة مالحديدية، أضف إلى ذلك أن التغيرات تتم بواسطة مولد جهد عتبي داخلي مجال عمله محصور بين القيمتين (-42 و +42) فولط و إشارة متناوبة ذات توتر وحيد يساوي 1 MHz

النتائج و المناقشة

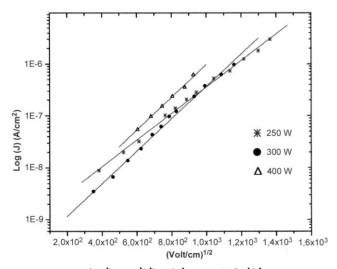
يبين الشكل (1) تغيرات (logJ(E) للعينات التي من خلالها نستطيع أن نتكلم عن نوعين من النقل تشملهما العينة ذات الاستطاعة 150 واط، أما العينات الثلاث الأخرى فتشمل نوعا

واحدا من النقل، فبيان العينة الأولى يمكن تقسيمه إلى منطقتين: منطقة أقل من V/cm التي تبدي تغيرات لو غاريتمية مع المعلم نصف اللو غاريتمي أي أن قيم كثافة التيار تتغير خطيا مع المجال الكهربائي أي أن النقل في هذه المنطقة أومي.



شكل 1: تغير كثافة التيار مع المجال الكهربائي.

أما المنطقة الثانية التي تبدأ من نهاية المنطقة السابقة، فزيادة إلى منحنيات العينات الأخرى فتبدي جميعها تغيرات دالة جذرية، لذلك رسمت تغيرات العلاقة $J(\sqrt{E})$ الموضحة في الشكل (2) الذي يبدي تغيرات خطية أي أن الدالة الأصلية تكون أسية و بما أن سمك العينات مرتفع فإن النقل عند هذه العينات هو أثر بول-فرنكل [10-11].

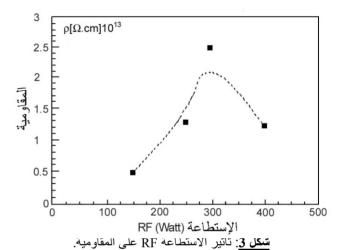


شكل 2: توضيح ظواهر النقل عند العينات.

و لتفسير هذا التغير في نمط النقل نرجع إلى الدراسة الضوئية لنفس العينات [10] و بالضبط إلى تغيرات العصابة الضوئية الممنوعة كونها المنطقة التي تتحكم في النقل نلاحظ أن الأشياء المميزة بين عينة 150 واطو العينات الأخرى هي الروابط المعلقة $^{\circ}N^{\circ}=$ و $^{\circ}S^{\circ}=$ التي تتصرف كمصائد لحوامل الشحن، حيث وجد أن عدد الروابط المعلقة قليل عند العينة الأولى بينما عند بقية العينات لوحظ زيادة في عرض ذيل عصابة التكافؤ إلى الداخل أي زيادة $^{\circ}N^{\circ}=$ و كذلك توضع الروابط المعلقة $^{\circ}S^{\circ}=$ في منتصف العصابة الممنوعة مشكلة تقريبا عصابة أو مستوى، و بسبب هذه الروابط المعلقة التي تقريبا عصابة أو مستوى، و بسبب هذه الروابط المعلقة التي

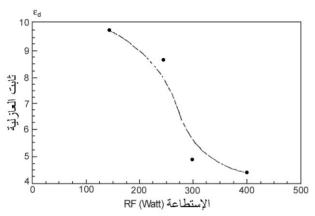
تتصرف كمصائد يمكن أن نفسر التغير المفاجئ في نمط النقل الناتج و منه نستنتج أن الاستطاعة RF تغير نمط النقل عند المجالات الضيقة.

الشكل (3) يمثل تغيرات المقاومية (ρ) المستنتجة من الشكلين السابقين حيث نلاحظ زيادة خطية بين القيمتين 150 واطو 300 واطثم يحدث تناقص قليل، هذا التغير يرجع أساسا إلى أنه عند زيادة الاستطاعة RF تقل البنية العمودية [12-13] و تتوزع ذرات الأزوت و السيليسيوم مما يؤدي إلى تكاثف المادة أي ارتفاع قيمة الكتلة الحجمية و انخفاض كثافة المسامات و بذلك تتناقص المقاومية بتناقص الاستطاعة RF أما الهبوط الملاحظ بين 300 و 400 واط فهو ناتج عن نقصان كمية الأزوت [14].



الشكل (4) يمثل تغير مجال الانهيار الذي يبدى تناقصا خطيا مع زيادة الاستطاعة و هذا راجع أساسا إلى البنيــة التركـيبية و إلى بنية الازوت داخل الرقائق حيث لوحظ من نتائج المطيافية تحت الحمراء [10] أنه كلما زادت الاستطاعة RF نقصت الروابط Si-N أي نقصان كمية الازوت و منه تهرب المادة من العازل إلى نصف الناقل. من ظواهر النقل المشاهدة و مفعول جول الذي ينص على أن درجة الحرارة ترتفع مع زيادة التيار، نستطيع أن نستنتج مباشرة أن العينة الأولى يكون مجال انهيارها أكبر من مجال بقية العينات لأن التيار يثبت عند هذه في مجال كبير نسبيا أي أن درجة الحرارة تكون بها منخفضة مقارنة بالعينات الأخرى التي تزايد بها التيار بسرعة مع زيادة الجهد. إرتفاع كثافة الحالات يؤدي إلى زيادة زمن التيار الانتقالي و منه إلى رفع درجة الحرارة. أما الشكل (5) فيوضح تغيرات ثابت العازلية الديناميكي (ε_d) المستنتج من ميل المنحنيات و هذا التغير متناقص بين 9,7 و 4,4 و هذا راجع إلى بنية الشرائح العمودية [10-13].

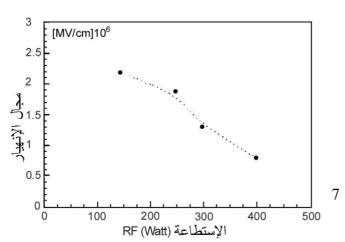
شكل 4: تأثير الاستطاعة RF على مجال انهيار العينات.



شكل 5: تأثير الاستطاعة RF على ثابت العازلية الديناميكي.

الشكل (6) يمثل منحنى السعة للعينة الأولى و يلاحظ تمدده و انرياحه عن المنحنيات المثالية أي التخلف و السقوط في الجهد، ففيما يخص التخلف فهو ناتج عن الشحن الحجمية بينما الثبوت الحادث في منتصف المنحنى تقريبا فهو ناتج عن حالات السطح البطيئة [15-16]، أما تغيرات المنحنيات مع الاستطاعة RF فقد حدث لها تمددات و انزياحات في اتجاه المحور الصفري، كما تزايدت قيمة السعة من PF 64 إلى PF 160 ، ففيما يخص النتائج الأولى فهي تبين تغير حالات الحجم و السطح أي كلما زادت الاستطاعة زادت هذه الحالات و هذا موافق للنتائج السابقة أي ارتفاع كثافة الحالات و تناقص مجال الانهيار.

أما النتائج الثانية و المتمثلة في قيم السعة فمن خلالها استنتج ثابت العازلية الساكن (ϵ_s) الموضح في الشكل (7) و الذي أبدى تزايدا كبيرا عند عينة 150 واطو هذا بسبب سيطرة الاستقطابية الثنائية على الإلكترونية [13] و هذا راجع للبنية العمودية لهذه العينة [10]، بينما التغيرات الحادثة بين القيمتين 250 واطو 400 واطفهي ناتجة من سيطرة الإستقطابية الإلكترونية و لتكاثف المادة [10] و زيادة الكتلة الحجمية بزيادة الاستطاعة RF [10-13].

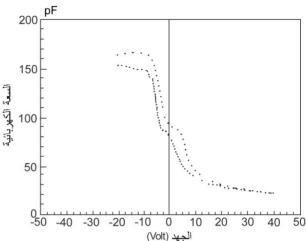


Mv/cm و Mv/cm و 0,8 Mv/cm و و هذا راجع للمسامات و زيادة المصائد. تغير الاستطاعة أثر أيضا على ثابت العازلية الديناميكي حيث تناقص من القيمة 9.73 إلى القيمة 4.4.

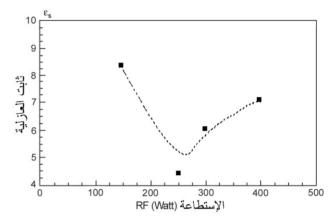
تغيرات السعة الكهربائية C(V) بينت أن الشرائح تحتوي على حوامل شحن بالحجم و منطقة التداخل و هذا واضح من السقوط في الجهد الذي أبدته بيانات C(V) و كذا التمدد الحادث بها، وهذه الخصائص أبدت زيادة بزيادة الاستطاعة RF، بينما ثابت العازلية الساكن فقد أبدى إرتفاعا كبيرا عند العينة 150 واط و هذا بسبب زيادة الاستقطابية الثنائية ثم حدث له سقوط سريع، بعدها بدأ في التزايد مع الاستطاعة و هذا راجع لزيادة الكتلة الححمية يزيادة الاستطاعة RF

المراجع

- [1]- Johnson C.C, Wydeven T. and Donohoe K., Solar Energy Mater, 31, (1983), p. 355.
- [2]- Powell M.G. and Orton J., Appl. Phys. Lett., 45, (1984), p. 171.
- [3]- Burgess T.E., Baum J.C., Fowkes F.M., Holmstron R. and G.A., *J. Electrochem. Soc.*, 116, (1968), p. 1005.
- [4]- Ramesh K., Chandorkar A.N. and Vasi J., *J. Appl. Phys.*, 70 (40), 15 august (1991).
- [5]- Yoshiaki Kamigaki, Shinichi Minami and Hisoyuki Kato, *J. Appl. Phys.*, 68 (5), 1 September (1990).
- [6]- Mogab C.J., Petroff P.M., and Shang T.T., *J. Electrochem. Soc.*, 122, (1975), p. 815.
- [7]- Shimakawa K. and Wakamatsu S., J. Appl. Phys., 68 (1), 1 July (1990).
- [8]- Hattori R. and Shirafuji J., *Journal of non Crystaline Solids*, 128, (1991), pp. 91-100.
- [9]- Jiong Huoi Zhou, Kengou Yamaguchi, Yamamoto and Tatsuo Shimuzu, *J. Appl. Phys.*, 74 (8), 15 October (1993).
- [10]- Aida M.S., Attaf A and Benkhedir M.L., *Phil. Mag.*, 73, (1996), p. 339.
- [11]- Dimaria D.J. and Arnet P.C., IBM. *J. Res. Develop.* (1977), p. 277.
- [12]- Mogab C.J. and Lugujjo E., J. Appl. Phys., 47, (1976), p. 1302.
- [13]- Hu S.M. and Gregor L.V., J. Electrochem. Soc., 114, (1967), p. 826.
- [14]- Cordes L.F., Appl. Phys. Lett., 11, (1967), p. 383.
- [15]- Sze S.M., "Physics of semiconductor devices", (1981), ed. J. Wiley et Sons.
- [16]- Nicolas E.H. and Brews J.R., "MOS Physics and Technology", (1982), ed. J. Wiley et Sons.



سكل 6: تغيرات السعة الكهربانية للعينة الاولى و توضيح السقوط في الحمد



شكل 7: تأثير الاستطاعة RF على ثابت العازلية الساكن.

الخلاصة

كان للإستطاعة RF تأثير واضح على الخصائص الكهربائية للعينات حيث بزيادتها تغير نوع النقل من الأومي إلى البول-فرنكل و شوهد هذا بين عينة 150 واطو العينات الأخرى، أما المقاومية (ρ) فقد أبدت تزايدا مع الاستطاعة و حصرت قيمتها بين Ω cm فيمتها بين Ω و شخاير فسلك سلوكا مغايرا راجع للبنية العمودية بينما مجال الانهبار فسلك سلوكا مغايرا حيث تناقص خطيا مع تزايد الاستطاعة RF بين القيمتين Ω